

DIN 32564-1

ICS 01.040.39; 39.020

**Fertigungsmittel für Mikrosysteme –
Begriffe –****Teil 1: Allgemeine Begriffe der Mikrosystemtechnik**

Production equipment for micro-systems –

Terms and definitions –

Part 1: General terms of micro-system technology

Équipement de production pour systèmes microtechniques –

Termes et définitions –

Partie 1: Termes fondamentaux de la technologie des systèmes microtechniques

Gesamtumfang 6 Seiten

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss „Fertigungsmittel für Mikrosysteme“ im Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

DIN 32564 „Fertigungsmittel für Mikrosysteme — Begriffe“ besteht aus:

- Teil 1: Allgemeine Begriffe der Mikrosystemtechnik
- Teil 2: Basistechnologien und Herstellung
- Teil 3: Handhabung, Lagerung und Transport

Einleitung

Diese Norm soll die Begriffe in dem relativ neuen Gebiet Mikrosystemtechnik zu einem Zeitpunkt klären, wo erste Produkte auf den Markt kommen. Es ist beabsichtigt, die Norm regelmäßig zu aktualisieren, um sie den Bedürfnissen von Kunden und Herstellern von Fertigungsmitteln anzupassen. Später sollen Definitionen aus anderen Normen, die mit Mikrosystemtechnik zu tun haben, hinzugefügt werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm definiert allgemeine Begriffe, die in der Fertigung von Mikrosystemen eingesetzt werden. Sie hat den Zweck, durch Festlegung einer einheitlichen Begriffsbildung die Verständigung über technische Inhalte zu erleichtern.

2 Begriffe

2.1 Anlagentechnik

2.1.1

Clustertool

integriertes, von der Umgebung isoliertes Fertigungssystem, das aus Prozess-, Transport- und Kassettensystemen besteht, die mechanisch und steuerungstechnisch verbunden sind

2.1.2

Gerätemodul

autarke Prozesseinheit, welche bei Bedarf über eine festgelegte Schnittstelle mit weiteren Prozesseinheiten zu einer Modulgruppe verbunden werden kann

2.1.3

Mini-Environment

begrenzte Zonen höherer Reinheit in Gerätemodulen zum Schutz des Produktes vor Verschmutzung und Beschädigung durch äußere Einflüsse

ANMERKUNG Das so genannte „Clean Machine Konzept“ beschränkt den Bereich der hochreinen Zone auf ein minimal notwendiges Volumen.